

Préparation d'échantillons pour la microscopie électronique en transmission par polissage mécanique en biseau

Nombre maximum de participants : 5

Intervenants : N. Mante (CEA-LETI, Grenoble), P. Vennéguès (CRHEA-Sophia Antipolis)

La préparation des échantillons est une étape primordiale pour le succès des études par microscopie électronique en transmission (MET). Cet atelier sera dédié à la préparation par polissage mécanique en biseau. Cette technique a démontré ses avantages pour obtenir des échantillons de très haute qualité, exempts d'artefacts (couche amorphe, redéposition), tout à fait adaptés à des observations en haute résolution avec des MET de dernière génération équipés de correcteurs d'aberration. Elle peut s'appliquer à de nombreux types de matériaux. Au cours de cet atelier, on suivra la préparation pour observation en section transverse de couches minces de semiconducteurs ayant une dureté très différente de celle de leur substrat (typiquement AlN/Si). Les différentes étapes d'une telle préparation (découpe des échantillons, collage pour la section transverse, polissage de chaque face...) seront mises en œuvre. Le polissage sera effectué sur une machine semi automatique Allied Multiprep.

Cet atelier se déroulera du lundi 29 Juin à 10h au mardi 30 Juin à 11h dans les locaux du CRHEA à Sophia Antipolis. A l'issue de cet atelier, les participants pourront rejoindre facilement le colloque sfμ2015 à Nice par les transports en commun. Les pauses café et le repas du lundi midi sont inclus.

Contact/information : P. Vennéguès (pv@crhea.cnrs.fr)